

機器名	走査型プローブ顕微鏡	
メーカー名・型番	セイコーインスツルメンツ社 SPI3800N	
分類	分析・観察関連	
仕様	検出系:光てこ方式、半導体レーザーおよび4分割変位検出系 分解能:面内 0.3nm、垂直 0.1nm 試料サイズ:25φ×5mm 走査範囲:20μm と 150μm 真空度:10 <sup>-8</sup> Torr 台 除振機構:空気バネ式除振台	
特徴	<p>当装置によって原子レベルからミクロンのスケールでの表面観察ができ、物質表面の組織観察はもちろん原子配列まで調べることが可能です。観察対象物質は金属、半導体、有機物と幅広く、生物試料を液中で観察することもできます。また、単に表面観察をするだけでなく、表面の形状を捉えながら、摩擦力、磁気力のマッピングや電流分布の観察が できます。さらに、ナノオーダーでの試料加工をすることができます。断面プロファイル、表面粗さ分析、グレーンサイズ分析も行うことができ、物質表面を総合的に、多角的な視点から 調べることができる装置です。平成 14 年度から、温調 (-150℃~400℃)、磁場印加(最大 ±0.1 T)装置が付加されました。平成 23 年度から、走査範囲が 20μm から 150μm のスキャナーに切り替えられるようになりました。</p>	